

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_ncvazzfr
NO_DOC_EXT:	2020-048097
SOFTWARE_VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	ufficioacquisti@polimi.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F01
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Politecnico di Milano

Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32

Città: Milano

Codice NUTS: ITC4C

Codice postale: 20133

Paese: Italia

Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture

E-mail: ufficioacquisti@polimi.it

Tel.: +39 0223999300

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.polimi.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.polimi.it/impresa/partecipaaunagara>

I.2) **Appalto congiunto**

I.3) **Comunicazione**

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Organismo di diritto pubblico

I.5) **Principali settori di attività**

Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Fornitura di un sistema di nanolitografia termica per il centro PoliFAB del Politecnico di Milano

II.1.2) **Codice CPV principale**

38000000

II.1.3) **Tipo di appalto**

Forniture

II.1.4) **Breve descrizione:**

Avviso di manifestazione di interesse per confermare i presupposti al ricorso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema di nanolitografia termica per il centro PoliFAB del Politecnico di Milano.

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:****II.2.2) Codici CPV supplementari****II.2.3) Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Il Politecnico di Milano intende acquistare un sistema di nanolitografia termica da installare nella facility di micro- e nano-fabbricazione PoliFAB. Tale sistema permetterà di soddisfare le esigenze degli utenti di PoliFAB, ampliando le possibilità a disposizione dei gruppi di ricerca e delle aziende rispetto a quanto possibile ora, nell'ambito della fabbricazione di nanodispositivi con applicazioni nella nanoelettronica, fotonica, ingegneria biomedica e scienza dei materiali.

Il sistema dovrà consentire di effettuare la nanofabbricazione di classi diverse di materiali tra cui film sottili di materiali polimerici, materiali bidimensionali (come il grafene o MoS₂), multistrati funzionali magnetici, materiali organici. Il sistema dovrà consentire la nanofabbricazione diretta di materiali, promuovendo fenomeni di conversione indotti termicamente (come sublimazione, cambiamenti di fase, reazioni chimiche) tramite la scansione di una sonda nanometrica calda sulla superficie del campione. Il sistema deve anche permettere l'imaging in-situ del substrato utilizzando la stessa sonda impiegata per la scrittura, per permettere la visualizzazione del substrato con risoluzione nanometrica nelle tre dimensioni, prima, durante e dopo il processo nanolitografico. Lo stesso sistema deve anche permettere la nanofabbricazione tramite irraggiamento con luce laser ultravioletta con risoluzione sub-micrometrica.

L'adeguatezza del sistema in termini di risoluzione spaziale, flessibilità nel gestire substrati di tipologia e dimensione variabile, capacità di nanostrutturazione tridimensionale, e presenza di un adeguato software in grado di gestire la movimentazione del campione, l'attuazione della sonda e del laser, lo stitching tra diverse aree di scrittura e l'imaging in-situ del campione, coordinati con il processo di nanolitografia, saranno ritenuti requisiti essenziali.

II.2.14) Informazioni complementari**II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:**

30/04/2020

Sezione IV: Procedura**IV.1) Descrizione****IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni**VI.3) Informazioni complementari:**

Le risposte alla manifestazione di interesse presentate alla data del 31.03.2020, termine di presentazione delle candidature previsto dall'avviso repertorio n. 2242, protocollo n. 46244 del 16.03.2020, pubblicato sulla GU S: [2020/S 056-131933](#), saranno considerate valide.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

10/04/2020